科学研究費助成事業

研究成果報告書 平成 28 年 6 月 1 4 日現在 機関番号: 33910 研究種目: 基盤研究(C)(一般) 研究期間: 2013~2015 課題番号: 25420074 研究課題名(和文)単結晶ダイヤモンド製マイクロフライス工具によるセラミックスの超精密切削 研究課題名(英文)Ultraprecision cutting of ceramics by micro milling tool of single crystal diamond 研究代表者 鈴木 浩文 (SUZUKI, Hirofumi) 中部大学・工学部・教授

研究者番号:20282098

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,000,000円

研究成果の概要(和文): DVD,デジタルカメラ等の情報電子デバイス,マイクロカプセル等の医療用マイクロデバ イスにおいて,非球面ガラスレンズの微小化,微細化,高精度化が強く要求されており,ガラス成形に対する高温耐熱 性のあるセラミックス型の超精密・微細加工が重要な課題となっている.従来のマイクロ・ダイヤモンドホイール(砥 石)による超精密研削加工では,工具摩耗等のため加工精度と能率に限界が生じていた.そこで本研究では,レーザ加 工による単結晶ダイヤモンドの微細加工技術を開発し,マイクロフライス工具を試作し,工具摩耗が非常に小さいこと を示し,硬質脆性材料であるセラミックスに対して鏡面切削の実現が可能であることを明らかにした.

研究成果の概要(英文): Micro aspheric glass lenses have been used in various devices, such as digital cameras, laser devices and medical devices. In order to machine micro aspheric ceramic molds precisely and efficiently, micro milling tools made of single crystalline diamond (SCD) are developed. Many cutting edges are fabricated 3-dimensionally on the edge of a cylindrical SCD by a laser beam. Flat binderless tungsten carbide mold was cut with the developed tool to evaluate the tool wear rate and its life. Some micro aspheric molds of tungsten carbide were cut with the tool at a rotational speed of 50,000 min-1. The molds were cut in the ductile mode. The form accuracy obtained was about 100 nm P-V and the surface roughness 12 nm Rz.

研究分野:精密加工学

キーワード:単結晶ダイヤモンドレス工具 延性モード切削 レーザ加工 セラミック 超精密切削 超硬合金 非球面金型 マイクロフライ

1.研究開始当初の背景

近年,デジタルカメラ等のデジタルデバイス,体内検査用のマイクロカプセル等の医療 デバイス,ブルーレーザなどのDVDデバイスに おいてマイクロ非球面レンズの微小化,高精 度化のニーズが急激に増大している.

これまで本報告者らはマイクロ非球面の 超精密研削・切削加工システムを開発し, マイクロデバイス用ガラスレンズを成形す るためのセラミックス製成形型の精密加工 への適用を行ってきた.その結果,世界最 小クラスのマイクロ非球面形状の超硬合金 型の精密加工を,ダイヤモンド砥石による 研削加工法により実現でき,0.05~0.1µmP -Vの形状精度と,10~30nmRyの表面粗さが 得た.また,近年,(i)ブルーレーザDVDなど の電子デバイス, (ii)デジタルカメラなどの デジタルデバイス,(iii)体内検査用マイクロ カプセル等の医療デバイスなどにおいて、素 子のガラス化,マイクロ(微小)化,高精度 化のニーズが急激に増大している.ガラス材 料を成形するためにはセラミック型による高 温(400~800)プレス成形プロセスが必要 であり、それを実施するためには「セラミッ クス製の型の超精密加工」が不可欠であり、 キーテクノロジーとなっている.

従来のセラミックの超精密加工には,マイ クロ・ダイヤモンドホイール(砥石)により 行われてきた.本提案者らはマイクロ非球面 の超精密研削・切削加工システムを開発し, マイクロデバイス用ガラスレンズを成形する ためのセラミックス製成形型の精密加工への 適用を行ってきた.提案者が開発した光通信 や光ピックアップ用マイクロレンズ成形型を 超精密に研削加工するためのマイクロ斜軸研 削方法および装置により世界最小クラスのマ イクロ非球面形状の超硬合金型の精密加工を, ダイヤモンド砥石による研削加工法により実 現した.そして,0.05~0.1µmP-Vの形状精度 と,10~30mRzの表面粗さが得られた. しかし,従来のダイヤモンドホイールによ る研削加工では,以下の問題点を有する.

(i)機上での砥石のツルーイング(成形)・ドレッシング(目立て)が不可欠で,非加工時間が多い.

(ii) 工具摩耗などのために工作物の加工精 度に限界が生じ,加工形状が安定しない.

(iii) また,それに伴う複雑な補正加工プロ セスが不可欠であり,加工形状精度の安定化 が重要な課題.

(iv) 微細な形状や構造的な形状に対して, 鈍な形状の砥石では加工である.

2.研究の目的

そこで本研究では、断続切削を実現できる 「マイクロフライス工具」による切削に着目 し、レーザ加工を応用して単結晶ダイヤモン ド製のマイクロフライス工具を創成すること を提案した.硬質脆性材料であるセラミック スに対して、耐摩耗特性が優れ、超精密金型 などの加工形状精度と加工表面粗さが安定し 優れた、断続切削を行うことのできる工具を 開発することが最終目的である.また、研削 加工や旋削加工では実現できなかったが、セ ラミックス材に微細で構造的な形状を超精密 に創成できる切削技術を解明した.

そのため,本研究提案書により,以下について明らかにする.

(1)単結晶ダイヤモンドの結晶方位によるレ ーザ加工の熱加工速度や表面粗さを明らかに する.

(2)一定時間,レーザビームを単結晶ダイヤモンドに照射すると,レーザビームのエネルギー密度分布により凹面形状に加工される.これは研磨加工における「単一加工痕」に相当し,この形状が最も良好な表面粗さが得られるレーザ照射条件を解明する.

(3)この単結晶ダイヤモンド上の単一加工痕 の分布形状から,デコンボリューション理論 によりレーザ走査軌跡と速度分布を計算する 理論を明らかにし,レーザの3次元軌跡を逆 算する方法を確立する.

(4)コンピュータ制御の4軸(X,Y,Z,,C)制御 の超精密加工機上に,上記レーザユニットを 搭載し,滞留時間制御レーザ加工システムを 構築し, 0.5~5mm程度の単結晶ダイヤモン ドの形状誤差分布を最小にするための形状修 正手法,工具軌跡条件を明らかにする.

(5)ダイヤモンドバイトによる旋削とは異な り,ダイヤモンドの回転工具による断続切削 の効果により,セラミックスの超精密切削が 可能となるのか.ダイヤモンド工具の先端に おける温度が,断続切削の場合,連続切削に 比べ,温度が減少し,それに伴い,ダイヤモ ンドの摩耗がどれだけ抑制されるかを定量的 に明らかにする.

(6)単結晶ダイヤモンドの結晶方位による硬度,へき開性,耐摩耗性を考慮し,工具形状, 方位を決定する方法を構築する.

上述のように本提案の単結晶ダイヤモンド 製マイクロフライス工具によるセラミックス の切削加工では、学術的特長を有し、セラミ ックの超精密・微細加工に対して、以下の結 果と効果が期待できる.

本提案の回転する多刃工具による切削(フ ライス加工)では,断続切削であるため工具 の加熱期間が短く,クーラントによる冷却期 間が長いため,工具温度が旋削加工のように 上がらない.

その結果,従来の旋削におけるRバイトほど 工具摩耗が大きくならず,工具摩耗が飛躍的 に抑制でき,耐摩耗性が飛躍的に向上する. 従来砥石に比べて1/100~1/1000の摩耗抑制 が期待できる.

回転工具は刃先の輪郭度精度の影響を受け ず真円として扱え,非球面形状の加工精度に 高周波の形状誤差(うねり)が転写されない. 計測補正加工無しで0.1µmP-V以下の形状精 度が期待できる.

多刃工具であるため実切り込み量は見かけ の切込量より十分に小さくなり,硬質脆性材 料でも延性モードの切削が実現しやすい.表 面粗さ10nmRz(2nmRa)が切削加工のみで期待 できる.

高脆材料であるセラミックスの延性モード 切削のメカニズムを明らかにできる. 以上のような結果が期待でき,デジタルデバ

イス,電子デバイス用の素子のガラス化,マ イクロ(微小)化,高精度化が可能になると 期待される.

3.研究の方法

単結晶ダイヤモンド工具によるセラミック スの断続切削の効果を実証し,マイクロガラ スレンズ成形用セラミック型の超精密切削加 工を実現するため,(1)レーザビーム走査装 置の設計・試作,(2)レーザビームによる単 結晶ダイヤモンドの加工特性の評価,(3)単 結晶ダイヤモンド製マイクロフライス工具の 試作,(4)単結晶ダイヤモンド製マイクロフ ライス工具の摩耗特性評価,(5)単結晶ダイヤ モンド製マイクロフライス工具による非球面 加工性の評価を行い,微小なマイクロガラス 光学部品の微細化,微小化,超精密化を実現 するための切削技術の確立,セラミックスの 延性モード切削メカニズムの解明を行った. (平成25年度)

<u>1.レーザビーム走査装置の設計・試作</u>

パルス・ファイバーレーザ(に集光光学系を 付加したレーザ走査システムの仕様を策定す る.詳細な光学設計は光学メーカに委託する. 次に,これらの設計・試作したパルス・ファ イバーレーザとレーザ集光光学系を,3軸制 御の位置決め装置(同時3軸制御)(既存のN C駆動装置)に搭載し,レーザビームスキャン 装置を試作した.

<u>2.レーザビームによる単結晶ダイヤモンド</u> の加工特性の評価

構築したレーザビーム走査装置を用い,単 結晶ダイヤモンドに対する基礎的な加工特性 を評価した.

(1)一定時間,レーザビームを単結晶ダイヤモンドに照射すると,レーザビームのエネルギー密度分布により凹面形状に加工される.これは研磨加工における「単一加工痕」に相当し,この形状が最も良好な粗さ分布が得られるレーザ照射条件を解明した.

(2) この単結晶ダイヤモンド上の単一加工痕 の分布形状から,デコンボリューション理論 によりレーザ走査軌跡と速度分布を計算する 理論を明らかにし,レーザの3次元軌跡を逆 算する方法を確立した.

(3)滞留時間制御レーザ加工システムを構築
 0.5~5mm程度の単結晶ダイヤモンドの
 形状誤差分布を最小にするための形状修正手
 法,レーザ走査条件を明らかにした.

(平成26年度)

<u>3 . 単結晶ダイヤモンド製マイクロフライス</u> <u>工具の試作</u>

(1) 単結晶ダイヤモンド製マイクロフライス 工具の形状を設計し,CAMデータを作成し,マ イクロ工具を試作した.工具は超硬のシャン クにロウ付けしてから,シャンクの外周を基 準にレーザ加工した.

(2)単結晶ダイヤモンドの結晶方位による硬度,へき開性,耐摩耗性を考慮し,工具形状,方位を決定する方法を構築した.

(3) 摩耗特性を比較するため,図のように先端がシャープなものとアール加工をしたものを試作した。

<u>4 . 単結晶ダイヤモンド製マイクロフライス</u> <u>工具の摩耗特性評価</u>

単結晶ダイヤモンドの結晶方位, 刃先のエ ッジのアールなど工具の仕様を変化させ, 摩 耗特性を評価する.試作した単結晶ダイヤモ ンド工具を超高速空気静圧スピンドルに取り 付け, 平面形状のセラミックス(超硬合金, 炭化珪素)を切削加工した.

(1) 摩耗の評価法:工具をスピンドルに取り

付けた直後と,所定の切込回数毎に,カーボ ン板をダミー材としてプランジカットし,そ の形状を非接触形状測定装置NH3SP(三鷹光器 (㈱製)により計測し,そのデジタルデータか らPCにて摩耗量を計算した(被削材の除去体 積)/(ダイヤモンドの摩耗体積)<研削に おける研削比に相当>により評価した.

(2) ダイヤモンドの各結晶方位に対するセラミックスの耐摩耗特性を評価し,データベース化した.

(3) 耐摩耗性を考慮し,最適な工具形状や結 晶方位を明らかにした.

(平成27年度)

<u>5 . 単結晶ダイヤモンド製マイクロフライス</u> 工具による非球面加工性の評価

最も優れた方位の工具を用いて,非球面形 状の超硬合金,SiC金型を超精密切削し,表面 粗さ,形状精度,摩耗量の変化を評価した. 切削加工実験装置としては同時4軸(X,Y,Z,C) 超精密加工装置ULG100DSH3(位置決め分解能1 nm)を,評価はZYGO社製表面粗さ計NewView6 200,Panasonic製形状測定器UA3P,三鷹光器 ㈱製形状測定器NH3SPを用いて行った.

4 . 研究成果

以上のように超硬合金などのセラミック スを超精密切削するために,図1に示すよう にレーザ走査により単結晶ダイヤモンドに 微細加工して,図2に示すようなマイクロ回 転工具を作製した.





 (a)先端が鋭利な工具 (b)先端がアールの (先端 R=0mm) 工具(R=0.5mm)
 図 2 レーザ加工で試作した単結晶ダイヤモンド製マイクロフライス工具



(b)SEM 写真図 4 工具摩耗の形態

次に図3に示すようにセラミックスの切削 基礎実験(工具摩耗,切りくずの観察)を行 い,最後に実際の非球面金型の切削を行い, その能力を評価した.その結果以下のことが 明らかとなった. (1) 工具として先端が尖った工具(図2(a)) とRがついた工具(図2(b))の2種類の工具 を用い, 3mmの非球面金型を切削し,形状 精度を表面粗さの変化を評価した.刃先先端 は図4に示すように摩滅型の摩耗形態を示す.
(2) 単結晶ダイヤモンドにおける工具の摩耗 量は図5のようであった.この値は,PCD(多 結晶ダイヤモンド)の約1/10以下,レジン ボンドダイヤモンド砥石の1/100以下と,本 工具の耐摩耗性の高さが明らかとなった.

(3) 超硬後金製の非球面形状金型の切削実験 を 20 回行った結果,形状精度は図 6 に示す ように 0.1-0.2µmP-V と非常に高精度な値を 維持する.

(4) 同様に切削実験を 20 回行った時の表面 粗さの変化は図 7 に示すように,10-30nmRz と非常に高精度な値を維持する.

(5) また, 刃先が丸いほど表面粗さは良好で あることが明らかとなった. 刃先が尖ってい る場合, 工作物を引っかく角度が鋭角となり 票目なら差が悪化すると考えられる.





5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計12件)

<u>
鈴木浩文</u>:超精密マイクロ微細加工(構造 的表面の創成),機械と工具,5,11(2015) p.8-12,ISSN0387-1053.【査読無】 <u>
鈴木浩文</u>:高硬度金型材料における切削加 工技術,型技術,30,10(2015)p.26-29, ISSN0912-5582.【査読無】

<u>H. Suzuki</u>, M. Okada, K. Okada, Y. Ito: Precision Cutting of Ceramics with Milling Tool of Single Crystalline Diamond, International Journal of Automation Technology, 9, 1, (2015) p.26-32, ISSN 1881-7629.【査読有】

<u>
鈴木浩文</u>:単結晶ダイヤモンド製マイクロ
フライス工具による超硬合金の超精密切削,
砥粒加工学会誌,59,8(2015)p.433-436,
ISSN0912-0289.【査読無】

<u>
鈴木浩文</u>:レーザにより創成したダイヤモ ンド製マイクロ工具を用いたセラミックの 超精密切削,レーザ加工学会誌,22,1(2015) p.8-12,ISSN1881-6797.【査読無】

<u>
鈴木浩文</u>:単結晶ダイヤモンド工具による 超硬合金製金型の超精密切削,光技術コンタ クト,52,8(2014)p.3-8,ISSN0913-7289. 【査読無】

<u>
鈴木浩文</u>:単結晶ダイヤモンド製マイクロ フライス工具の開発と超硬合金の超精密切削, 機械技術,62,1(2014)p.22-25,ISSN0451-9396. 【査読無】

<u>H. Suzuki</u>, M. Okada, S. Matsui, Y. Yamagata: Development of micro milling tool made of single crystalline diamond for ceramic cutting, Annals of the CIRP, 62, 1(2013) p.59-62, ISSN0007-8506. 【查読有】

<u>
鈴木 浩文</u>: 微細加工へのニーズと対応技 術,機械技術,3,8(2013) p.13-16, ISSN0387-1053. 【査読無】

<u>
鈴木浩文</u>,岡田 睦:セラミックスなど硬 脆材料の超精密・微細加工技術,機械技術, 61,7(2013)p.17-22,ISSN0451-9396.【査 読無】

〔学会発表〕(計2件)

<u>
鈴木浩文</u>,中野恵太,岡田 睦,岡田浩一, 伊藤洋介,三浦太久真:マイクロフライス工 具による超硬金型の超精密切削(第3報)-工具摩耗の評価-,2014年度精密工学会春季 大会学術講演会講演論文集(2014.3.18,東 京大学・東京都文京区),p.501-502.

〔図書〕(計1件) 奥山繁樹,宇根篤鴨,由井明紀,<u>鈴木浩文</u>: 機械加工学の基礎,コロナ社(2013),229.

〔その他〕 ホームページ等: http://www.chubu.ac.jp/about/faculty/pr ofile/81055a74934afd47b755fc8aca81a2b9e 76024dc.html

6.研究組織
(1)研究代表者: 鈴木浩文(SUZUKI, Hirofumi)
中部大学・工学部・教授
研究者番号: 20282098

(2)研究分担者:無

(3)連携研究者:無